2002-010555 [01] **WPIDS** ΑN

DNC C2002-002537

Preparation of sterically hindered N-oxyl used as polymerization inhibitor for styrene, comprises reacting sterically hindered secondary amine and oxidation agent in the presence of catalyst.

DC A60 E13

KUBOYAMA, H: NAGAI, N

PA (MITA) MITSUI CHEM INC

CYC 23

A1 20010920 (200201)* JA ы WO 2001068606 16

RW: AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE TR

W: CN KR US

JP 2002145861 A 20020522 (200249)

6<--

ADT WO 2001068606 A1 WO 2001-JP2059 20010315; JP 2002145861 A JP 2001-75943 20010316

PRAI JP 2000-260930

20000830; JP 2000-73859

20000316

2002-010555 [01] **WPIDS** AN

WO 200168606 A UPAB: 20020730 AB

> NOVELTY - Sterically hindered N-oxyl compound is prepared by oxidizing a sterically hindered secondary amine using an oxidation agent in the presence of a catalyst from carbonate, urea, silicate and silicic acid.

> DETAILED DESCRIPTION - Preparation of sterically hindered N-oxyl compound of formula (II) comprises oxidizing a sterically hindered secondary amine of formula (I) using an oxidation agent in the presence of a catalyst from carbonate, urea, silicate and silicic acid.

R1-R4 = lower alkyl, lower alkenyl, aralkyl, aryl, acyl, or aroyl;

A = a divalent group necessary for forming a 5-6 membered ring.

USE - The product is used as a polymerisation inhibitor for styrene, acrylonitrile, acrylic acid, methacrylic acid or vinyl acetate or as a light stabilizer for resins.

ADVANTAGE - The preparation has high yield.

Dwg.0/0

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-145861 (P2002-145861A)

(43)公開日 平成14年5月22日(2002.5.22)

| (51) Int.Cl. ⁷ | 識別記号 | F I | テーマコード(参考) |
|---------------------------|------|----------------|------------|
| C 0 7 D 211/94 | | C 0 7 D 211/94 | 4 C 0 5 4 |
| // C07B 61/00 | 300 | C 0 7 B 61/00 | 300 4H039 |
| C08F 2/38 | | C 0 8 F 2/38 | 4J011 |

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 6 頁)

| (21)出願番号 | 特顧2001-75943(P2001-75943) | (71) 出願人 | 000005887 | |
|-------------|------------------------------|----------|-----------------------|--|
| | | | 三井化学株式会社 | |
| (22)出顧日 | 平成13年3月16日(2001.3.16) | | 東京都千代田区震が関三丁目2番5号 | |
| | | (72)発明者 | 永井 直 | |
| (31)優先権主張番号 | 特顧2000-73859(P2000-73859) | | 千葉県袖ヶ浦市長浦580-32 三井化学株 | |
| (32)優先日 | 平成12年3月16日(2000.3.16) | | 式会社内 | |
| (33)優先権主張国 | 日本 (JP) | (72)発明者 | 久保山 久春 | |
| (31)優先権主張番号 | 特願2000-260930 (P2000-260930) | | 千葉県袖ヶ浦市長浦580-32 三井化学株 | |
| (32)優先日 | 平成12年8月30日(2000.8.30) | | 式会社内 | |
| (33)優先権主張国 | 日本 (JP) | (74)代理人 | 100088328 | |
| | | | 弁理士 金田 暢之 (外2名) | |
| | | | | |

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 立体障害N-オキシル化合物の製造方法

(57)【要約】

【課題】 本発明は、立体障害N-オキシル化合物を安価かつ高収率で製造する方法を提供することを目的とする。

【解決手段】 一般式(I)で表される立体障害二級アミンをカーボネート類、ウレア類、ケイ酸、ケイ酸塩から選ばれる1種以上の化合物の存在下、酸化剤によって酸化することにより、一般式(II)で示される立体障害N-オキシル化合物を製造する。

【化1】

$$\begin{array}{c|c}
R^{1} & & & \\
R^{2} & & & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& &$$

R^1 R^2 R^4 (II)

(式中、 $R^1 \sim R^4$ は同一又は相異なり低級アルキル基、低級アルケニル基、アラルキル基、アリール基、アシル基、アロイル基を表し、Aは $5 \sim 6$ 負環を形成するのに必要な2 価の基を表す。)

(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式(I)

【化1】

(式中、 $R^{1} \sim R^{4}$ は同一又は相異なり、低級アルキル 基、低級アルケニル基、アラルキル基、アリール基、ア 10 im. France, 11, 3237 (1965))。 シル基、または、アロイル基を表し、Aは5~6員環を 形成するのに必要な2価の基を表す。) で表される立体 障害二級アミンを、カーボネート類、ウレア類、ケイ 酸、ケイ酸塩から選ばれる1種以上の化合物の存在下、 酸化剤によって酸化することを特徴とする一般式(Ⅰ I)

【化2】

$$R^{1}$$
 R^{2}
 R^{2}
 R^{4}
(II)

(式中、 $R^{1} \sim R^{4}$ およびAは前記と同義である。) で表 される立体障害N-オキシル化合物の製造方法。

【請求項2】 用いる酸化剤が過酸化水素である請求項 1記載の方法。

用いるケイ酸塩が、ケイ酸ナトリウムで 【請求項3】 ある請求項1または2記載の方法。

用いるカーボネート類がジメチルカーボ 【請求項4】 ネートである請求項1または2記載の方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、スチレン、アクリ ロニトリル、アクリル酸、メタクリル酸、酢酸ビニル等 の重合禁止剤、樹脂の光安定剤、酸化反応触媒、また は、ラジカル重合調節剤として有用な立体障害N-オキ シル化合物の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】二級アミン類の酸化による対応するN-オキシル化合物(N-オキシラジカルまたはニトロキサ 40 イドともいう)の合成は公知である。例えば、R. Wint erらは有機過酸化物を用い(ヨーロッパ特許出願公開15 7738)、Chuらは例えば酸化剤としてm-クロロ過安息香 酸を用いている(J. Org. Chem., 39, 2356, 2360(1947))。 これらの方法は高価な酸化剤を使用しており、工業的な 方法としては問題がある。

【0003】これに対し、過酸化水素を酸化剤として用 いる方法も種々提案されている。D.P.Youngらはタング ステン酸塩の存在下、過酸化水素で酸化する方法を推奨 している (英国特許 1 1 9 9 3 5 1、Tetrahedorn 20,

131, (1964))。この方法は、数日間という長い反応時 間と触媒廃棄の問題がある。触媒として炭酸ナトリウム を用いる場合でも、長すぎる反応時間が必要である(Do kl. Akad. Nauk. SSSR、261,109(1981))。炭酸ナトリウ ムを原料に対して触媒量(0.05~0.3当量)使用 する場合でも、反応時間が長いことが問題である(ドイ ツ特許4432795)。リンタングステン酸を用いる 場合には、反応時間が短縮されるが、依然として触媒廃 棄の問題が残る(例えば、R. Brieweら、Bull. Soc. Ch

【0004】また、二酸化炭素を用いる方法(特開平8 -3136)、2価金属を少量添加する方法(特開平6 -100538) は前述の問題点を克服はしているが、 反応時間がいぜん長いという問題点がある。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、上記 問題点を克服し、立体障害N-オキシル化合物を安価か つ高収率で製造する方法を提供することである。

[0006]

【課題を解決するための手段】発明者らは過酸化水素を 安定化または活性化しうる添加剤を鋭意探索、検討した 結果、カーボネート類、ウレア類、ケイ酸およびケイ酸 塩に過酸化水素に影響を与え反応を加速する効果がある ことを見出した。しかも、添加量は原料の二級アミンに 対し数mol%程度の触媒量でも効果が発現することが分か った。

【0007】即ち、本発明は、一般式(I)で表される 立体障害二級アミンをカーボネート類、ウレア類、ケイ 酸、ケイ酸塩から選ばれる1種以上の化合物の存在下、 酸化剤によって酸化することを特徴とする一般式(I I) で表される立体障害N-オキシル化合物の製造方法 に関するものである。

[0008]

【化3】

$$\begin{array}{c|c}
R^{1} & A & R^{3} \\
R^{2} & R^{4} & (I)
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R^{1} & A & R^{3} \\
R^{2} & R^{4} & (II)
\end{array}$$

(上式中、 $R^{1} \sim R^{4}$ は同一又は相異なり、低級アルキル 基、低級アルケニル基、アラルキル基、アリール基、ア シル基、または、アロイル基を表し、Aは5~6員環を 形成するのに必要な2価の基を表す。)

[0009]

【発明の実施の形態】本発明を以下に具体的に説明す る。本発明は、前記一般式(I)で表される立体障害二

級アミンを原料とする一般式(II)で表される立体障害N-オキシル化合物の安価かつ高収率な製造方法である。

【0010】 一般式(I) および(II) において、R $1\sim R^4$ は同一であっても、異なっていてもよく、それぞれ、低級アルキル基、低級アルケニル基、アラルキル基、アリール基、アシル基、または、アロイル基を表し、Aは $5\sim 6$ 員環を形成するのに必要な2 価の基を表す。

【0011】5~6 員環を形成するのに必要な 2 価の基 10 Aとは、下記のいずれかの基を表す。

[0012] -CHXCHY (CHZ) $_{n}$ -COCH₂ (CH₂) $_{n}$ -

 $-CH_2COCH_2-$

〔上式中、X、Y、Zは同一又は相異なり、水素原子、 ハロゲン原子、アミノ基、または $-OR^5$ 基 $\{R^5$ は水素 原子、低級アルキル基、低級アルケニル基、アラルキル 基、アリール基、または、-C (=O) R^6 基 (但し、 R^6 は水素原子、低級アルキル基、低級アルケニル基、 アラルキル基、または、アリール基を表す)を表す $\}$ を 20 表し、nは0または1を表す。 $\}$

本願において、低級アルキル基としては、直鎖、分岐または環状の炭素数1~8のアルキル基であり、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、n-ペンチル基、ネオペンチル基、シクロペンチル基、n-ヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基等が挙げられる。

【0013】低級アルケニル基としては、直鎖または分岐の炭素数2~6のアルケニル基であり、例えば、ビニ 30ル基、アリル基、イソプロペニル基、4-ペンテニル基、5-ヘキセニル基等が挙げられる。

【0014】アラルキル基としては、例えば、ベンジル基、フェネチル基、ベンズヒドリル基、フェニルプロピル基等が挙げられる。

【0015】アリール基およびアロイル基のアリール部分としては、例えば、フェニル基、ナフチル基等が挙げられる。

【0016】アシル基としては、例えば、ホルミル基、アセチル基、プロピオニル基、プチリル基、バレイル基、ピバロイル基等が挙げられる。

【0017】ハロゲン原子としては、フッ素、塩素、臭素またはヨウ素が挙げられる。

【0018】これらの中で、 $R^1 \sim R^4$ としては、低級アルキル基が好ましく、特にメチル基、エチル基が好ましい。

【0019】また、基Aとしては、 $-CH_2CH$ (OH) CH_2- 、 $-CH_2CH$ (NH₂) CH_2- 、 $-CH_2$ CH CH_2- 、 $-CH_2COCH_2-$ が好ましく、中でも $-CH_2CH$ (OH) CH_2- が好ましい。

【0020】一般式(I)で表される化合物として、具体的には、4-ヒドロキシー2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジン、2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジン、2, 2, 6, 6-テトラメチルー4-ピペリドンが好ましい。

【0021】本発明の製造方法では、反応はカーボネー ト類、ウレア類、ケイ酸、ケイ酸塩から選ばれる1種以 上の化合物の存在下に行われる。反応系に共存させるカ ーポネート類はカーボネート類ならばどのようなもので も良いが、例えばジメチルカーボネート、ジエチルカー ボネート、ジ-n-プロピルカーボネート、ジイソプロピ ルカーボネート、ジ-n-プチルカーボネート、ジイソブ チルカーボネート、ビス (2-メチルアリル) カーポネー ト、アリルメチルカーボネート、メチルイソプロピルカ ーポネート、ジ-n-オクチルカーボネート、ジ(2-メト キシメチルエチル)カーポネート、ジ(2-エトキシエチ ル)カーポネート等の鎖状カーボネート類、エチレンカ ーポネート、プロピレンカーボネート、ビニレンカーボ ネート、クロロエチレンカーポネート、ジクロロエチレ ンカーボネート、1,3-ジオキサン-2-オン等の環状カー ボネート類、ジメチルジカーボネート、ジエチルジカー ボネート、ジ-tert-ブチルジカーボネート、ジ-tert-ア ミルジカーボネート、ジアリルジカーボネート等のジカ ーポネート類を挙げることができる。コスト上の理由か らジメチルカーポネートが好ましい。

【0022】反応系に共存させるウレア類はウレア類な らばどのようなものでも良いが、例えばウレア、メチル ウレア、1,3-ジメチルウレア、1,1-ジメチルウレア、1, 1, 3, 3, -テトラメチルウレア、エチルウレア、1, 2-ジエ チルウレア、1,3-ジエチルウレア、n-ブチルウレア、ア リルウレア、1,3-ジアリルウレア、1,3-ジシクロヘキシ ルウレア等の鎖状ウレア類、2-イミダゾリドン、1,3-ジ メチル-2-イミダゾリジノン、1,3-ジアシル-2-イミダゾ リジノン、テトラヒドロ-2-ピリミドン等の環状ウレア 類を挙げることができる。効果の点から1,1,3,3,-テト ラメチルウレア、1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノンが 好ましい。反応系に共存させるケイ酸としては、ケイ酸 ならばどのようなものでも良いが、例えば、無水ケイ 酸、ケイ酸n水和物、シリカゲル、コロイダルシリカ等 を挙げることができる。コスト上の理由からケイ酸n水 和物が好ましい。

【0023】反応系に共存させるケイ酸塩としては、ケイ酸塩ならばどのようなものでも良いが、例えば、ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム(水和物)、オルソケイ酸ナトリウム、ジケイ酸ナトリウム、トリケイ酸ナトリウム、ケイ酸リチウム、オルソケイ酸リチウム、ケイ酸カリウム、ケイ酸セシウム、ケイ酸ジルコニウム、ケイ酸アルミニウム、ケイ酸マンガン、ケイ酸モリケイ酸鉛、ケイ酸チタン、ケイ酸マンガン、ケイ酸モリプデン、ケイ酸ベリリウム、ケイ酸ナトリウムアルミニ

ウム、ケイ酸リチウムアルミニウム、ケイ酸リチウムジルコニウム、ケイ酸テトラメチルアンモニウム等を挙げることができる。経済性、効果の点からナトリウム塩、特にケイ酸ナトリウムが好ましい。

【0024】これらのカーボネート類、ウレア類、ケイ酸、ケイ酸塩は単独で使用しても良いし2種類以上を混合して使用しても良い。カーボネート類、ウレア類、ケイ酸、ケイ酸塩の使用量は原料の二級アミンに対し、0.01モル%~100モル%、好ましくは0.11モル%~100モル%、さらに好ましくは1モル%~50モル%である。

【0025】本発明においては、反応の際に、溶媒を用いてもよい。反応に用いる溶媒としては、水、または、水溶性で酸化反応に不活性な有機溶媒である。有機溶媒としては、例えば、メタノール、エタノール、nーまたはイソープロパノール、nー、イソーまたは第三ープタノール、エチレングリコール、プロピレングリコール、エチレンジグリコール、プロピレンジグリコール、アルキルグリコールエーテル等が挙げられる。これらの溶媒は単独で、または混合して用いられる。特に有利な溶剤は、経済的理由から、水、メタノール、エタノール、または、イソプロパノールである。溶剤の使用量は、原料の0.5~20重量倍、好ましくは、0.8~10重量倍、さらに好ましくは1~5重量倍である。

【0026】本発明において、反応に用いる酸化剤としては原料の2級アミンを酸化してN-オキシルに変換しうるものならばどのようなものでもよいが、例えば過酸化水素、メチルエチルケトンパーオキサイド、メチルイソプチルケトンパーオキサイド、シクロヘキサノンパーオキサイド等のケトンパーオキサイド類、アセチルパーオキサイド、オクタノイルパーオキサイド類、 t-ブチルヒドロパーオキサイド、クメンヒドロパーオキサイド、ジーt-ブチルヒドロパーオキサイド類、 t-ブチルヒドロパーオキサイド類、 t-ブチルピドロパーオキサイド類のヒドロパーオキサイド類、 t-ブチルパーオキシアセテート等のアルキルパーエステル類、過ギ酸、過酢酸、m-クロロ過安息香酸等の過酸類を挙げることができる。これらの酸化剤の中で反応性と経済性から過酸化水素が好ましい

【0027】過酸化水素としては、どのような濃度のも 40 のでもかまわないが、安全性と反応性を考えて、 $3\sim9$ 0重量%、好ましくは $5\sim7$ 0重量%水溶液、さらに好ましくは $10\sim5$ 0重量%水溶液である。使用量としては、原料に対して化学量論量(1.5 当量)以上ならばいずれでもよいが、化学量論量の $5\sim5$ 0%過剰が好ましい。

【0028】反応は、例えば、次のように行う。まず、 原料の二級アミンと、カーポネート類、ウレア類、ケイ 酸、ケイ酸塩から選ばれる1種以上の化合物およびイオ ン交換水を導入し、反応温度を10~100℃、好まし 50

くは30~90℃、さらに好ましくは50~80℃に調整する。反応の開始剤として、目的とするN-オキシル化合物を触媒量反応初期に添加してもよい。酸化剤を選択された時間で滴下した後、選択された温度で、更に1~24時間撹拌する。反応圧力は常圧、加圧のいずれでもよい。反応の経過は、ガスクロマトグラフィー(GC)により確認する。

【0029】反応終了後、残存する過剰の過酸化水素は、触媒量のプラチナー活性炭またはパラジウムー活性炭を用いて分解してもよく、あるいは、水酸化ナトリウム等の塩基を用いて反応溶液のpHを11以上にして加熱撹拌により分解してもよい。あるいは、亜硫酸ナトリウムを添加して、塩基性条件下で分解してもよい。反応により生成したNーオキシル化合物は、有機溶媒により抽出するか、あるいは、反応後、油層(Nーオキシル層)が2層分離する場合は、それを分離し精製してもよい。

【0030】抽出に用いる溶媒としては、有機物を抽出可能なものならばどのようなものでもよく、例えば、塩化メチレン、クロロホルムに代表されるハロゲン化炭化水素、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン(THF)に代表されるエーテル類、ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼンに代表される芳香族化合物、酢酸エチルで代表されるエステル類などの不活性な有機溶媒が挙げられる。これらは単独で、または混合して用いてもよい。

【0031】有機溶媒による抽出方法は、原料液に対し、 $0.01\sim100$ 倍、好ましくは $0.1\sim10$ 6の体積の有機溶媒を加え、 $0\sim100$ で撹拌した後、油層を分離する。撹拌時間は特に限定されるものではないが、通常 $0.5\sim5$ 時間の範囲である。

【0032】抽出したN-オキシル化合物は、場合によっては、抽出溶媒の溶液のまま用いることもでき、また、溶媒を留去する等の処理により得られた固体を用いることもできる。

[0033] 精製を必要とする場合は、再結晶等により容易に純度を上げることができる。再結晶に用いる溶媒としては、不活性な溶媒であればいずれでも良いが、例えば、水、ペンタン、ヘキサン又はヘプタン等の炭化水素類、トルエン、キシレン又はエチルベンゼン等の芳香族炭化水素類、メタノール、エタノール、プロパノール又はプタノール等のアルコール類が挙げられる。これらの溶媒は単独で、または混合して用いてもよい。

[0034]

【実施例】以下に実施例を示すが、本発明はこれらの実 施例に何ら限定されるものではない。

【0035】<実施例1>

(反応)

300mL 4ロフラスコに、4-ヒドロキシ-2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジン(以下、4-ヒドロキシTEMP



と略す) 50.0g(318mnol)、イオン交換水50m 1、ジメチル カーボネート (DMC) 1.43g(1 5.9mnol、原料に対し5mol%)を加え撹拌しながら65 でまで昇温した。35%過酸化水素水65g(669mno l)を1時間かけて滴下した。滴下終了後、内温68℃ で2.5時間撹拌した。室温まで冷却後、GC(内標ジ フェニルエーテル)で反応成績を定量したところ、原料4-ヒドロ キシTEMPの転化率98.3%、目的物の4-ヒドロキ シ-2,2,6,6-テトラメチルピペリジン N-オキシル(以 下、4-ヒドロキシTEMP-N-オキシルと略す)の 10 収率97.3%、選択率99.0%であった。

【0036】(単離精製)反応溶液に48%水酸化ナトリウム水溶液を加えpHを12にした後、60℃で2時間撹拌し、余剰の過酸化水素を分解した。室温まで冷却*

*後、酸を用いて反応溶液を中和した。反応溶液に飽和するまで食塩を加えた後、トルエンで二度抽出を行った。トルエン溶液に撹拌しながらヘキサンを添加することにより4-ヒドロキシTEMP-N-オキシルを晶析させた。結晶をろ取、ヘキサンで洗浄後、室温で減圧下乾燥(1.3hPa)を3時間行った。4-ヒドロキシTEMP-N-オキシルの橙色結晶を47.3g(GC純度99.6%、273mmol、単離収率86%、融点71.5~72.0℃(Aldrich catalog, mp=69~71℃))得た。

【0037】〈実施例2~11〉ジメチルカーボネートの使用量または添加剤の種類を変更した以外は実施例1 と同様に反応を行った。結果を表1に示した。

[0038]

【表1】

| | | 反応成績(%) | | | |
|-----|---------------------------------|--------------|--------------------|------|--|
| 実施例 | 添加物 | 4-E *04>TEMP | 4-ヒドロキシTEMP-N-オキシル | | |
| | (使用量 mol%)* | 転化率 | 選択率 | 収率 | |
| 2 | シャメチル オーネ・ネート (50) | 94.7 | 95 | 90 | |
| 3 | シ*メチル カーホ*ネート (30) | 98.2 | 99 | 97.2 | |
| 4 | シ*メチル カーお*ネート (10) | 98 | 99 | 97 | |
| 5 | シャメチル カーホ・ネート (1) | 98.2 | 98.7 | 96.9 | |
| 6 | シ*エチル カーホ*ネート (30) | 97 | 96.9 | 94 | |
| 7 | エチレン カーホ・ネート (30) | 94.8 | 99.9 | 94.6 | |
| 8 | プロピレン カーポネート (30) | 94.6 | 99 | 93.6 | |
| 9 | シャメチル シャカー本・ネート (30) | 97 | 96.9 | 94 | |
| 10 | 1,3-シ*メチル-2-イミタ*ソ*リシ*ノン (30) | 96.5 | 95 | 91.7 | |
| 11 | 1,1,3,3-717444717 (30) | 97 | 94.8 | 92 | |

*:4-ヒドロキシTEMPに対する添加量

<実施例12>

(反応) 300mL4ロフラスコに、4-ヒドロキシT 30 EMP50.0g(318mmol)、イオン交換水50ml、ケイ酸ナトリウム0.65g(10.7mmol、原料に対し3.3mol%)を加え、撹拌しながら65℃まで昇温した。35%過酸化水素水65g(669mmol)を1時間かけて滴下した。滴下終了後、内温65℃で4.5時間撹拌した。室温まで冷却後、GC(内標、ジフェニルエーテル)で反応成績を定量したところ、原料4-ヒドロキシTEMPの転化率97.5%、目的物の4-ヒドロキシTEMPーNーオキシルの収率95.0%、選択率97.5%であった。 40

【0039】(単離精製)反応溶液に、48%水酸化ナトリウム水溶液を加え、pHを12にした後、60℃で2時間撹拌し、余剰の過酸化水素を分解した。室温まで冷却後、希塩酸を用いて反応溶液を中和した。反応溶液

に飽和するまで食塩を加えた後、トルエン100mlで2度抽出を行った。撹拌しながらトルエン溶液に、ヘキサンを添加することにより4-ヒドロキシTEMP-N-オキシルを晶析させた。結晶をろ取した後、ヘキサンで洗浄し、減圧(1.3hPa)下、室温で3時間乾燥を行い、4-ヒドロキシTEMP-N-オキシルの橙色結晶を、46.7g(GC純度99.6%(270.3mmol)、単離収率85%)得た。

融点71.5~72.0℃ (Aldrichカタログ、mp=69~71℃)

[0040]

【表2】

表:

10

| 実施例 | 添加物 (使用量) | 反応 時間 (hr) | 反応成績(%) | | |
|------|--------------------|------------------|-------------|---------------------|------|
| | | | 4-ヒト*ロキシTEM | 4-L1.04>TEMP-N-14>1 | |
| | | | P転化率 | 選択率 | 収率 |
| 13 | ケイ酸ナトリウム(30mol%)* | 5 | 97.2 | 97.7 | 95.0 |
| 14 | ケイ酸ナトリウム(10mol%) | 5 | 97.4 | 96 | 93.5 |
| . 15 | ケイ酸ナトリウム(3.3mol%) | 7 | 97.1 | 97 | 94.2 |
| 16 | ケイ酸ナトリウム(2.0mol%) | 5 | 95.3 | 94.4 | 90.0 |
| 17 | メタケイ酸ナトリウム(30mol%) | 3 | 87.2 | 91.6 | 80.0 |
| 18 | ケイ酸カリウム(5.0mol%) | 5 | 90.0 | 89.0 | 80.0 |
| 19 | ケイ酸(10vt%) | 5 | 93.7 | 95.5 | 89.5 |
| 20 | ケイ酸(5wt%) | 3 | 85.5 | 85.5 | 73.2 |
| 21 | 71酸(2vt%) | 3 | 87.5 | 88.9 | 77.8 |
| 22 | シリカケール(10vt%) | 3 | 87.2 | 87.6 | 76.4 |

a:かっこ内は4-th'叶汀DIPに対する使用量

<実施例23>

(反応) 300mL4ロフラスコに、4-ヒドロキシT EMP50.0g(318mmol)、イオン交換水50ml、 ケイ酸ナトリウム0.65g(10.7mmol、原料に対し3. 3mol%)を加え、撹拌しながら75℃まで昇温した。35 %過酸化水素水65g(669mmol)を0.5時間かけて滴 下した。滴下終了後、内温75℃で3時間撹拌した。室 20 温まで冷却後、GC(内標、ジフェニルエーテル)で反 応成績を定量したところ、原料4-ヒドロキシTEMPの転化率99%、目的物の4-ヒドロキシTEMP-N ーオキシルの収率97%、選択率98%であった。

【0041】(単離精製) 反応溶液に、48%水酸化ナトリウム水溶液を加え、pHを12にした後、65℃で3時間撹拌し、余剰の過酸化水素を分解した。室温まで冷却後、希塩酸を用いて反応溶液を中和した。反応溶液に飽和するまで食塩を加えた後、トルエン50mlで抽出を行った後、更にトルエン25mlで2度抽出を行った。得られたトルエン溶液を減圧濃縮(トルエンを35ml留去)した後、撹拌しながら5℃に冷却した。得られた結晶を室温で減圧乾燥することにより4−ヒドロキシTEMP−N−オキシルが47.4g (GC純度99.4% (273.7mmol)、単離収率86%)得た。晶析母液

には4-ヒドロキシTEMP-N-オキシルが21.1 mmol、原料の4-ヒドロキシTEMPが0.4mm ol含まれていた。この晶析母液は次回の晶析時にリサイクル使用可能であった。

【0042】 < 比較例1>実施例12において、ケイ酸ナトリウムを使用しないこと以外は、実施例12と同様の方法で反応を行った。その結果、4-ヒドロキシTEMP-Nーオキシルの反応収率42.6%、選択率82.7%であった。

【0043】 <比較例2>ケイ酸ナトリウムの代わりに 炭酸ナトリウム (原料に対し10mo1%) を使用した 以外は実施例12と同様の方法で反応を行った。その結果、4-ヒドロキシTEMPの転化率78.7%、4-ヒドロキシTEMP-N-オキシルの反応収率77.3%、 選択率98.2%であった。

0 [0044]

【発明の効果】本発明により、スチレン、アクリルニトリル、アクリル酸、メタクリル酸、酢酸ビニル等の重合禁止剤または樹脂の光安定剤として有用な立体障害Nーオキシル化合物を安価かつ高収率で製造することが可能になった。

フロントページの続き

Fターム(参考) 4C054 AA02 BB03 CC07 DD04 DD08

EE01 FF01

4H039 CA72 CC60

4J011 NA02 NB01 NB03